

# 小光斑薄膜测量仪 及反射光度计



## 小光斑薄膜测量仪及反射光度计：

用于亚毫米尺寸器件（100  $\mu\text{m}$  – 500  $\mu\text{m}$ ）表面光学反射率、薄膜厚度、及薄膜材料光学参数（n&k）的快速测量。可以在 0.1 秒内同时获取单层薄膜的厚度和材料光学参数。该仪器可用于各种环境，如实验室、工厂生产线及野外的实时测量。

## 关键优势：

- 小光斑：测量光斑直径从 100  $\mu\text{m}$  到 500  $\mu\text{m}$
- 测速快：单点测量时间小于 0.1 秒
- 精度高：反射率精度 0.3 %，膜厚精度 0.2 nm
- 波长范围：350 nm 至 1000 nm，1000 nm 至 1700 nm
- 小型便携：重量 2.5 公斤，USB 连接计算机，软件易学好用

## 应用领域：

- 光学镀膜：镜片增透膜、高反膜、分光膜测量
- 医疗器件：内窥镜镜片反射率、内聚对二甲苯保护层、医疗器械表面涂层测量
- 半导体制造：二氧化硅（ $\text{SiO}_2$ ）、氮化硅（ $\text{Si}_3\text{N}_4$ ）、ITO（氧化铟锡）、有机发光层、聚酰亚胺（PI）、光刻胶厚度测量
- 太阳能电池：氮化硅减反射膜、氧化铝钝化层测量

| 参数   | 技术指标                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 测量内容 | 反射率，膜层厚度及光学常数（n&k）                                                         |
| 光斑大小 | 100 $\mu\text{m}$ ，200 $\mu\text{m}$ ，300 $\mu\text{m}$ ，500 $\mu\text{m}$ |
| 膜厚范围 | 15 nm 至 100 $\mu\text{m}$ ，精度为 0.2 nm                                      |
| 测量时间 | 单点测量时间小于 0.1 秒                                                             |
| 光谱范围 | 350 nm 至 1000 nm，1000 nm 至 1700 nm                                         |
| 样品尺寸 | 1 mm 至 100 mm                                                              |
| 仪器重量 | 2.5公斤                                                                      |
| 仪器尺寸 | 29 x 23 x 22 cm                                                            |
| 数据处理 | USB 数据传输，配套软件 Spectra_Sensor 及 Film_Analyzer                               |
| 操作系统 | Windows 10及以上系统                                                            |
| 电源   | 100-240 VAC，50/60 Hz，0.4 A                                                 |